## ЛЕКЦИЯ 19. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

## Эффективность термоэлектрических генераторов

КПД термоэлектрического генератора:

$$\eta = \frac{T_{\Gamma} - T_X}{T_{\Gamma}} \cdot \frac{\sqrt{(1 + Z\overline{T})} - 1}{\sqrt{(1 + Z\overline{T})} + T_X / T_{\Gamma}}$$

где ТГ и ТХ – температура горячих и холодных спаев ТЭ, соответственно;

 $\overline{T} = (T\Gamma + TX)/2;$ 

Z-термоэлектрическая добротность.



Рисунок 1. График зависимости ZT от Т

1 – Bi2Te2.8Se0.2 (0.14 мас % CdCl2), 2 – Bi0.5Sb1.5Te3 (2 мас % Te, 0.14 мас % TeI4), 3 – Bi2Te2.4Se0.6 (0.18 мас % CuBr), 4 – Bi0.4Sb1.6Te3 (0.12 мас % PbCl2, 1.50 мас % Te), 5 – PbTe (0.2 мас % PbI2, 0.3 мас % Ni), 6 – GeTe (7.4 мас % Bi), 7 – Si0.8Ge0.2 (2.2 мас % P), 8 – Si0.8Ge0.2 (1.8 мас % B).



Рисунок 2. Измерительный комплекс для исследования термоэлектрических параметров материалов. Интервал рабочих температур от +25°C до + 800°C



Рисунок 3. Схема ячейки для измерения термоэлектрических параметров материалов. Интервал рабочих температур от +25°C до +



Рисунок 4. Внешний вид ячейки для измерения термоэлектрических параметров материалов



Исследование теплопроводности материалов

Рисунок 5. Схема установки для измерения теплопроводности по Е.Д. Девятковой и А.В. Петрову для низких температур



Рисунок 6. Схема установки для измерения теплопроводности по Е.Д. Девятковой и А.В. Петрову для высоких температур



Рисунок 7. Схема установки по Бауэрсу



Рисунок 8. Схема метода Х.И. Амирханова



Рисунок 9. Схема установки по методу Кольрауша



Рисунок 10. Схема установки лямда-калориметра.

Тепловая схема метода: 1 – медное основание; 2 – пластина из нержавеющей стали; 3 -контактная пластина; 4 – исследуемый образец; 5 – стержень.



Рисунок 10. Схема установки лямда-калориметра.

Схема измерительной ячейки: 1 – пластина из нержавеющей стали; 2 – контактная пластина; 3 – испытуемый образец; 4 – стержень; 5 – корпус; 6 – термопары; 7 – медное основание.



Рисунок 11. Измерительный комплекс для исследования термоэлектрических параметров материалов. Интервал рабочих температур от минус 60° С до + 400° С



Рисунок 12. Схема измерительной ячейки:

1 – основание; 2 – исследуемый образец; 3 – градиентный нагреватель; 4,5,8,9 – датчики температуры; 6 – охранный нагреватель; 7,13 – теплоизоляция; 10,11 – токовые зонды; 12 – разъем; 14 – направляющие; 15 прижимной винт; 16 - экран.



Рисунок 13. Структурная схема измерительного комплекса для исследования ТКЛР



Рисунок 14. Схема установки измерительной ячейки в термоэлектрическом калибраторе



Рисунок 15. Измерительная ячейка для исследования КПД термоэлектрических устройств и тепло электрофизических параметров материалов



Рисунок 16. Структура измерительного комплекса для исследования влияния режимов и параметров питания на эффективность TOУ



*Рисунок 17. Измерительная ячейка:* 1 – жидкостной теплообменник; 2 – ТЭМ;

3 – резистивный нагреватель; 4, 5 – теплопровод.



Рисунок 18. Программно-реконфигурируемый измерительный комплекс для исследования термоэлектрических преобразователей энергии